

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 3 部門第 4 区分
 【発行日】平成 28 年 3 月 31 日 (2016.3.31)

【公開番号】特開 2015-36451 (P2015-36451A)
 【公開日】平成 27 年 2 月 23 日 (2015.2.23)
 【年通号数】公開・登録公報 2015-012
 【出願番号】特願 2013-168591 (P2013-168591)
 【国際特許分類】

C 2 3 C 14/04 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

H 0 5 B 33/10 (2006.01)

【F I】

C 2 3 C 14/04 A

H 0 5 B 33/14 A

H 0 5 B 33/10

【手続補正書】

【提出日】平成 28 年 2 月 15 日 (2016.2.15)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 1】

本開示は、蒸着等に用いられるマスクに加える応力を調整する蒸着用マスク、これを用いた表示装置の製造方法に関する。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 8】

本開示の第 4 の表示装置の製造方法では、上記本開示の第 4 の蒸着用マスクを用いて有機層を形成するようにしたので、精度良く有機層のパターンを形成することができ、パネルの高精細化につながる。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 4 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 4 2】

調整機構 4 0 は、支持部材 3 0 を介して、可動部材 2 0 X , 2 0 Y (即ちマスク本体 5 5) に張力 (引っ張り力) を加える引きボルト 4 1 と、押圧力を加える押しボルト 4 2 とを備える。図 5 は、この調整機構 4 0 付近の X Y 平面構成を表したものである。図 6 A は、図 5 における II - II 線断面図であり、図 6 B は、図 5 における III - III 線断面図である。尚、ここでは、可動部材 2 0 X , 2 0 Y のうち、可動部材 2 0 Y に設けられた調整機構 4 0 を例に挙げて説明する。また、図 6 A および図 6 B では、マスク本体 5 5 と可動部材 2 0 Y との溶接ポイントを L で示している。